

22/10/02
2002063857



(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

162162

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2002年9月12日 (12.09.2002)

PCT

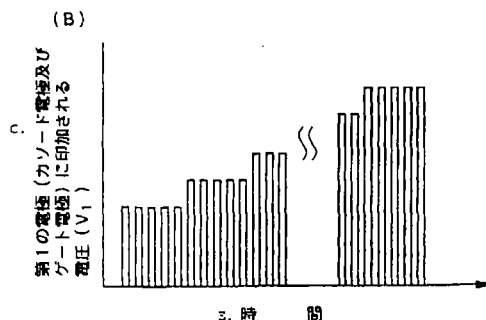
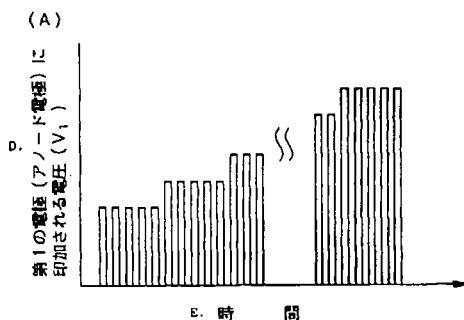
(10) 国際公開番号
WO 02/071434 A1

- (51) 国際特許分類: H01J 9/04, 31/12 (72) 発明者; および
(21) 国際出願番号: PCT/JP02/00494 (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 小西 守一 (KON-
(22) 国際出願日: 2002年1月24日 (24.01.2002) ISHI, Morikazu) [JP/JP]; 〒141-0001 東京都品川区北
(25) 国際出願の言語: 日本語 品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内 Tokyo (JP).
(26) 国際公開の言語: 日本語 飯田 耕一 (IIDA, Koichi) [JP/JP]; 〒141-0001 東京都品
(30) 優先権データ: 特願2001-63365 2001年3月7日 (07.03.2001) JP 川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): ソニー株 Tokyo (JP).
式会社 (SONY CORPORATION) [JP/JP]; 〒141-0001
(81) 指定国 (国内): CN, KR, SG, US.

[続葉有]

(54) Title: KNOCKING PROCESSING METHOD IN FLAT-PANEL DISPLAY DEVICE, AND KNOCKING PROCESSING METHOD IN FLAT-PANEL DISPLAY DEVICE-USE SUBSTRATE

(54) 発明の名称: 平面型表示装置におけるノッキング処理方法、及び、平面型表示装置用基板におけるノッキング処理方法



C...VOLTAGE (V1) APPLIED TO FIRST ELECTRODE (CATHODE AND GATE ELECTRODE)
D...VOLTAGE (V1) APPLIED TO FIRST ELECTRODE (ANODE ELECTRODE)
E...TIME

(57) Abstract: A knocking processing method in a flat-panel display device comprising a first electrode-carrying first substrate and a second electrode-carrying second substrate that are disposed with a vacuum space therebetween and joined to each other at the peripheral edge portions thereof, wherein a voltage V1 higher than that applied to the second electrode is applied to the first electrode in a pulse form to field-evaporate protrusions existing on the first electrode.

[続葉有]

WO 02/071434 A1



ACTION